Support Request Form 利用相談フォーム

Please fill in this form and send it to Electron Microscopy Unit office as an email attachment.
依頼内容をご記入いただき、電子顕微鏡ユニット事務局までメール添付にてお送りください。
Email: tem@nims.go.jp
The technical staff member in charge will provide a usage consultation based on the following information.
以下の内容をもとに、担当の技術スタッフが利用相談を行います。

〈Date 日付: *month* 月 *day* 日 *year* 年〉

User information 利用者情報				
Applicant 申請者	**Name** 氏名（フリガナ）			
	Company (Organization)/Division 会社（組織）名・所属			
	Job Title/Position 職名/肩書			
	Grade For students **Period of stay in NIMS** for members of NIMS internship program			
	Period of stay in NIMS for visiting researchers			
	E-mail address		**Phone Number**	
Supervisor 責任者	**Name** 氏名（フリガナ）			
	Company (Organization)/Division 会社（組織）名・所属			
	Job Title/Position 職名/肩書			
	E-mail address		**Phone Number**	

For NIMS users only NIMS 内部利用者の方へ			
Please fill in an application ID if obtained. 既に課題 ID を取得済みの方はご記入ください。 Ex) 24NMXXXX	ID: NM	About Data Provision データ提供について	☐ Cannot provide data due to confidentiality obligations. 守秘義務によりデータ提供できない

For people from companies and academia 企業・大学等の方へ	
Please select one option regarding the research outcomes obtained through shared use. 共用設備利用で得た研究成果公開の有無について、どちらかを選択して下さい。	☐ Disclosure of Research Results 成果公開 ☐ Non-Disclosure of Research Results 成果非公開
Please answer the following options about data provision if you are considering using "**ARIM**". **「マテリアル先端リサーチインフラ」**をご検討の方は、データ提供ご協力の有無についてお聞かせ下さい。	☐ I am interested in data provision for ARIM. ARIM へのデータ提供について検討している ☐ I use ARIM without data provision. データ提供無しで ARIM を利用する ☐ I am not sure. よくわからない

Research Summary 研究概要

Selection of the usage type and related questions 利用形態の選択と質問

Please select A or B for your preferred usage type. 利用形態のご希望について、A もしくは B をお選びください

For the selected usage type (A or B), please check the ones that apply to you. 選択した利用タイプについて、ご回答ください

☐ **A. Equipment Operation by users 機器利用**

⇒ Operate equipment and acquire data by yourself ユーザー自身が機器を操作しデータを取得

▶Please select the type of equipment you wish to use and *provide the name of the equipment* if you have specified ones. (e.g., JEM-2100) ご希望の装置種を選択いただき、指定機器があれば*装置名をご記入ください*（JEM-2100 等）

☐ TEM ：.....

☐ SEM ：.....

☐ FIB ：.....

☐ Others その他：.....

▶ Which of the following would you judge your experience to be? あなたの経験は次のどれに当てはまると思いますか？

☐ Having no experience at all 全く経験がない

☐ Having enough practical skill 十分経験がある

▶ Please indicate for reference the model(s) you have experience in NIMS by checking boxes or write the name.
参考のため、NIMS 施設で使用経験のある装置にチェックを入れて下さい。リスト以外の場合はご記入ください。

Equipment model name	Equipment location
☐ JEM-ARM300F, ☐ JEM-2800, ☐ JSM-7900F, ☐ SMF-1000, ☐ Scios2, ☐Auriga Laser	SENGEN site (Advanced Structural Materials)
☐ Talos F200X G2, ☐ JEM-2100F, ☐ JEM-2100, ☐ JEM-ARM200F, ☐ Helios 650, ☐ NB5000	SENGEN site (Physical Analysis Laboratories)
☐ Talos F200X G2, ☐ Ethos NX5000, ☐ NanoMill Model1040	NAMIKI site
Equipment other than the above 上記以外の装置：	

☐ **B. Equipment Operation on behalf of users 技術代行**

⇒ Operate equipment and acquire data by EM unit 電子顕微鏡ユニットによる分析支援サービス

▶Please check appropriate boxes as follows. 当てはまるものにチェックを入れて下さい。

☐ TEM Sample preparation and TEM observation TEM 試料作製と TEM 観察

☐ Only TEM sample preparation TEM 試料作製のみ

☐ Only TEM observation TEM 観察のみ

☐ SEM observation SEM 観察

※Please provide details of your preferred measurement method and sample information on page 4.
ご希望の測定手法および試料情報の詳細は、4・5 ページ目に記載ください。

Sample Information 試料情報			
Sample Name 試料名			
Sample Type, Form, Structure 試料の構成			☐ Bulk バルク ☐ Monolayer 単層膜 ☐ Multilayer 多層膜 ☐ Nano-sized particles ナノサイズ粒子 ☐ Micron-sized particles ミクロンサイズ粒子 ☐ Others: その他：
Electrical Characteristics 電気特性			☐ Conductor 導体、☐ Semi-conductor 半導体、☐ Insulator 絶縁体
Magnetic Property 磁気特性			☐ Ferromagnetic (Fe/Co/Ni) 強磁性（鉄/コバルト/ニッケルなど） ☐ Ferrimagnetic (Ferrite etc.) フェリ磁性（フェライトセラミックスなど） ☐ Non-Magnetic 非磁性
Elements contained in the sample 含有元素			
If the material contains biological components, please answer the questions on the right." 生物由来の材料を含む場合は、右の設問に回答ください。	**Does it contain pathogens?** 病原を含みますか？		☐ Yes 病原を含む ☐ No 病原を含まない
	Is a specific facility (e.g., BSL rating or GMO-equipped lab) required to handle this? 特別な実験設備（BSL、GMO 等）が必要ですか？		☐ Yes 特別な実験設備が必要 ☐ No 特別な実験設備が必要でない

Precautions when handling sample 試料に関する注意事項

☐ Toxic 劇物・毒物 ☐ Diffusible 拡散性 ☐ Volatile 揮発性 ☐ Oxidizable 酸化性 ☐ Photoreactive 光反応性

☐ Heat-resistant temperature 耐熱温度［ ℃］ ☐ Water reactive 水反応性

☐ Intolerance for organic solvent such as ethanol or acetone 耐薬品性（アセトン・エタノール）

☐ Destruction Allowed 破壊可 ☐ Destruction not Allowed 破壊不可

☐ Others to be noted その他［ ］

Remarks (if any) その他特記事項	

➢ **Pease fill in the following only if you wish to have a "Technical Surrogate".**

以下は技術代行をご希望の方のみご記入ください。

- If you do not have enough space, please add pages. Other attachment accepted.
  スペースが足りない場合は、ページを追加してください。別紙添付でも可

Number of Samples 試料数	
Please set priorities for which sample to start with If there is more than one sample. 試料が複数ある場合、優先順位を教えて下さい	
Directions of observation 観察方向	☐ Cross section 断面 ☐ Plan view 平面 ☐ Any direction 方位不問
Sample disposal 試料廃棄について	☐ It is OK to dispose of them. 廃棄してよい ☐ I need the samples returned. 試料の返却を希望する

Detailed information about your sample 詳細な試料情報

※Not necessarily required if sample preparation is not requested.試料作製を依頼しない場合は必須ではない

Initial form, size, surface roughness, crystal orientation to observe, region of interest as specifically as possible to easy understand using schematic drawings or photos. In case of Crash and Dispersion method, write the name of usable and unusable solvent.
初期形状・サイズ、表面の状態、観察したい結晶方位、特定の加工希望位置の全体写真とその部分の拡大写真、平面図、断面図などわかるように記載ください。分散法など懸濁が必要な場合は、使える溶媒と使えない溶媒を記載ください。

Detailed information about analytical techniques you request 依頼したい分析手法

※You don't need this information if you request only sample preparation. 試料加工のみ依頼の場合は不要

TEM: HR-TEM, STEM-EDS, STEM-EELS, EDS Mapping, Line Analysis, Electron Diffraction Pattern etc.
HR-TEM、STEM-EDS、STEM-EELS、マッピング、線分析、電子線回折図形等。

SEM: surface observation, cross-sectional observation, EDS measurement, EBSD measurement etc.
表面観察，断面観察，EDS 測定，EBSD 測定等